(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2006 年8 月24 日 (24.08.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/087894 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/673 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2006/301352

(22) 国際出願日: 2006 年1 月27 日 (27.01.2006)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2005-027910 2005 年2 月3 日 (03.02.2005) JP
特願2005-132385 2005 年4 月28 日 (28.04.2005) JP
特願2005-137537 2005 年5 月10 日 (10.05.2005) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 信越ポリマー株式会社 (SHIN-ETSU POLYMER CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1030023 東京都中央区日本橋本町四丁目３番５号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小田嶋 智 (ODASHIMA, Satoshi) [JP/JP]; 〒3360031 埼玉県さいたま市南区鹿手袋六丁目７番２７号４０７ Saitama (JP). 細野 則義 (HOSONO, Noriyoshi) [JP/JP]; 〒3620073 埼玉県上尾市浅間台四丁目１６番２８号 Saitama (JP).

(74) 代理人: 藤本 英介, 外(FUJIMOTO, Eisuke et al.); 〒1000014 東京都千代田区永田町二丁目１４番２号山王グランドビルヂング３階３１７区 藤本特許法律事務所内 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

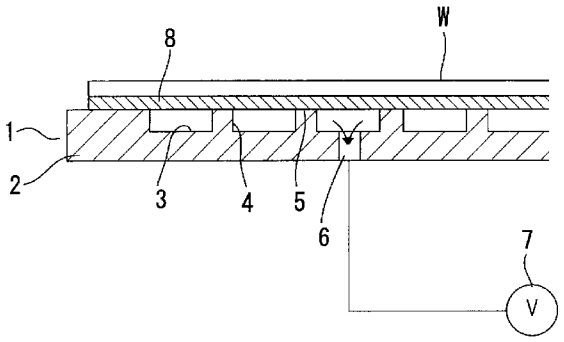
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) **Title:** FIXATION CARRIER, PRODUCTION METHOD OF FIXATION CARRIER, USE METHOD OF FIXATION CARRIER, AND SUBSTRATE RECEPTION CONTAINER

(54) 発明の名称: 固定キャリア、固定キャリアの製造方法、固定キャリアの使用方法、及び基板収納容器



(57) **Abstract:** Provided are a fixation carrier capable of appropriately transporting an easily warpable and breakable article, a production method of the fixation carrier, a use method of the fixation carrier, and a substrate reception container. The fixation carrier has partitioned spaces (3) that are formed as depressions in the surface of a rigid base material (2) and are covered in a layered manner by a holding layer (8) for holding a semiconductor wafer W; projections (4) that are arranged side by side next to the partitioned spaces (3) to support the holding layer (8) in a contacting manner; and an air discharge path (6) that is provided in the base material (2) and guides air in the partitioned spaces (3), covered by the holding layer (8), to the outside. The semiconductor wafer W that is easily warpable and breakable is not directly received in a container body of the substrate reception container but received in the container body while being held by the holding layer (8) of the fixation carrier (1). As a result, the wafer W can be safely and appropriately transported to a factory.

[続葉有]

WO 2006/087894 A1

(57) 要約:

反りやすく割れやすい被搭載物品を適切に輸送することのできる固定キャリア、固定キャリアの製造方法、固定キャリアの使用方法、及び基板収納容器を提供する。

剛性を有する基材（２）の表面に凹み形成され、半導体ウェーハＷを保持する保持層（８）に積層被覆される区画空間（３）と、この区画空間（３）に並設されて保持層（８）を接触支持する複数の突起（４）と、基材（２）に穿孔されて保持層（８）に被覆された区画空間（３）の空気を外部に導く排気路（６）とを備える。反りやすく割れやすい半導体ウェーハＷを基板収納容器の容器本体に直接収納するのではなく、固定キャリア１の保持層（８）に保持させた状態で収納するので、工場に安全、かつ適切に輸送できる。